



100 years
Carl Zeiss in Japan

Technical seminar for new CDB Imaging Facility

New generation laser scanning microscope LSM780
Super-resolution microscope ELYRA PS.1

日時 2011年6月15日 (水)

15:00 - 15:30 LSM780によるFCS, FCCS セミナー (担当: カールツァイス 佐藤)

15:30 - 16:00 超高解像度顕微鏡 ELYRA セミナー (担当: カールツァイス 矢口)

会場 理研CDB A棟7階 N701 セミナー室

※ This seminar is conducted in Japanese,
but English information materials will be prepared.
※ An instruction session will be held upon request.

<セミナー内容>

● LSM 780 - GaAsP spectral detector を利用した FCS, FCCS のご紹介

LSM 780 特徴

- ・32Ch GaAsP (ガリウム砒素燐) PMT を世界で初めての採用によりGaAsPスペクトルイメージングが可能
- ・32Ch GaAsP PMTで従来比2倍の高感度
- ・32Ch GaAsP PMTにより最大6Chまで同時測定が可能に
- ・ポイントスキニング方式で最速の250 frame/sec (@512 × 16 pixel)
- ・フォトンカウンティングイメージングによる極微弱蛍光の可視化
- ・蛍光相関 / 相互相関分光法 (FCS / FCCS)
- ・倒立型顕微鏡: Axio Observer Z1 with 10x, 20x, 40x, 63x, 100x objectives
- ・その他アクセサリ (CO₂インキュベーションシステム、XYスキニングステージ<タイル、マルチポイント>)

● 最先端 超高解像度顕微鏡 ELYRA システムのご紹介

ELYRA 特徴

- ・簡便な操作のStructured Illumination Microscopy (SIM) により分解能100 nmを実現
- ・分解能約20 nmを実現する超解像光学顕微鏡 Photoactivated Localization Microscopy (PAL-M)
- ・SIMとPAL-Mを一つのソフトウェアより切り替え可能



A New Dimension
in Confocal Microscope

Contact:
Carl Zeiss MicroImaging Co., Ltd.
Yasuhiko Sato (佐藤 康彦)
E-mail: sato.ya@zeiss.co.jp
Tel: 6-6337-5465

Contact in CDB:
Optical Imaging INFO counter
Office: A-N206 Ext: 1221
E-mail: oimg-info@riken.cdb.jp
<http://cii.cdb.riken.jp/>

